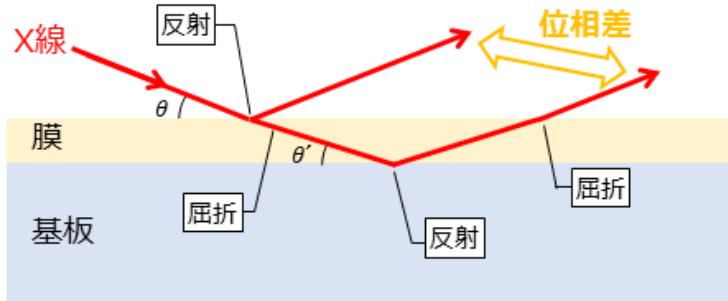


特徴

- ・多層膜の構造評価が可能
- ・結晶質・非晶質ともに適用可能
- ・非破壊

《測定原理》



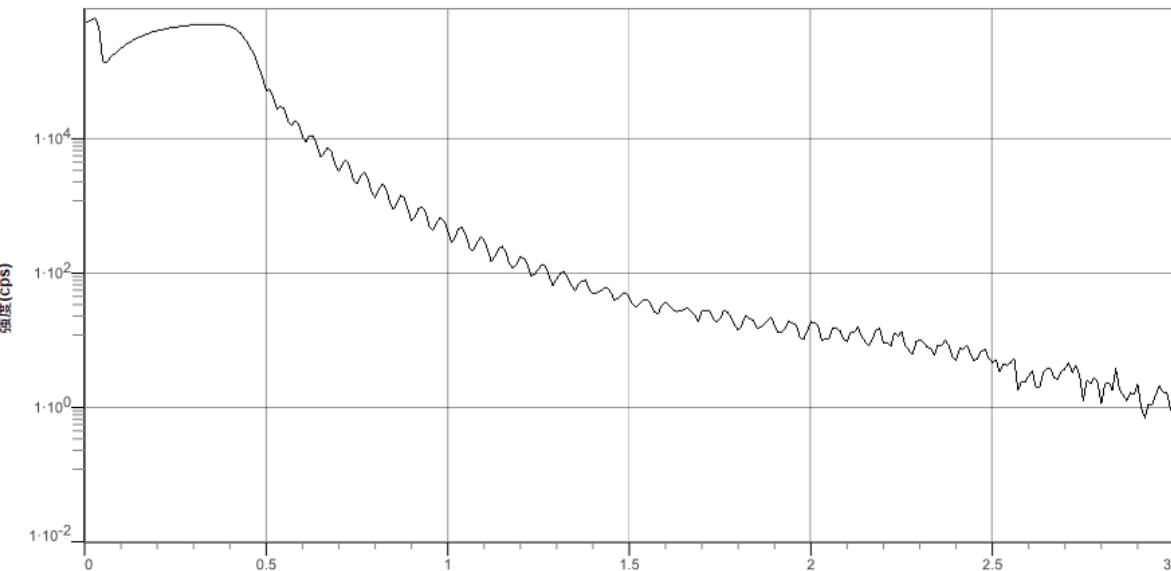
膜表面・基板表面で反射されたX線が干渉し
反射強度が振動

→解析により膜厚,粗さ,密度を取得

《XRR測定でわかること》

- ・1~1000nm程度の膜厚
- ・表面および界面の粗さ
- ・各層の密度

〈XRRプロファイル〉



膜構成	膜厚(nm)	密度(g/cm ³)	粗さ(nm)
DLC	147.584	1.70493	0.914
Si (基板)	-	2.32924	0.140